

國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

儀器使用人員教育訓練與資格檢定 成果報告表

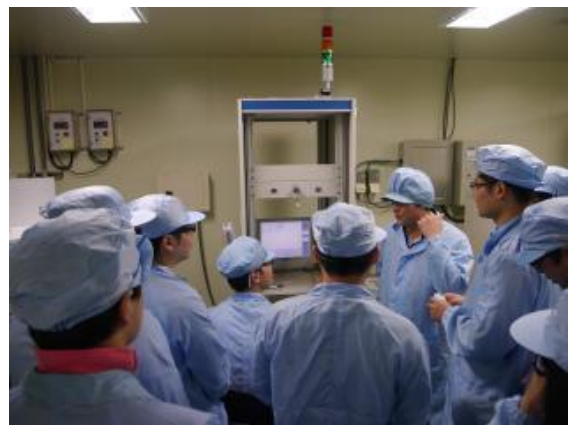
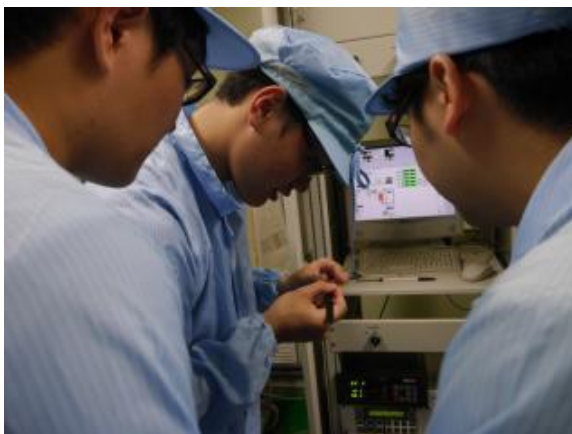
課程名稱	共同儀器中心培訓研習會-電漿耦合式離子蝕刻機		
儀器名稱 (中英文名稱)	電漿耦合式離子蝕刻機 Inductive Couple Plasma Etching System;ICP-RIE		
課程時間	103年4月18日(五)		
主辦單位/中心	奈米科技中心		
報名人數	17人		
檢定項目	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證		
通過人員名單	系所單位	姓名	
	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證		
發證率	本本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證		
費用收入	8,500元		
費用支出	講師費：8,000元 餐費：1,425元 影印費：200元	總計	9,625元
課程表			
講題	日期	地點	主講人
電漿耦合式離子蝕刻機 原理與系統簡介	4/18(五) 11:00~12:20	格致館 4F 會議室	國家實驗研究院 儀器科技研究中心 真空科技與奈米製程 組 陳哲勤 副研究員
電漿耦合式離子蝕刻機 製程氣體安全講解	4/18(五) 13:00~14:00	藝薈館 B1F 奈米科技中心	
電漿耦合式離子蝕刻機 上機操作演示	4/18(五) 14:00~17:30	藝薈館 B1F 奈米科技中心	

訓練/課程照片

原理與系統簡介上課照片



操作演示課程上課照片



1. 請於開辦教育訓練結束二周內填妥本表，電子檔逕寄科技研究總中心科技服務組李佳樺助理 chli@cc.ncue.edu.tw，另請將費用核銷用之紙本單據，請送至科總中心，俾利辦理訓練費用核銷及成果訊息刊登等事宜，校內分機 1702，若有填表相關問題請與我聯繫，謝謝您的協助。

2. 本表資訊公開公告於 <http://hrst2.ncue.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=41>